

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年9月10日(10.09.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/177310 A1

(51) 国際特許分類:

B05D 1/02 (2006.01) *G03B 21/608* (2014.01)
B05D 3/00 (2006.01) *H04N 5/74* (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01) *B05B 7/04* (2006.01)

MANAGEMENT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5406207
大阪府大阪市中央区城見2丁目1
番61号 Osaka (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/007975

(22) 国際出願日: 2021年3月2日(02.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願 2020-037059 2020年3月4日(04.03.2020) JP
特願 2020-037060 2020年3月4日(04.03.2020) JP

(72) 発明者: 木村 航太(KIMURA Kota). 小林 陽介(KOBAYASHI Yosuke). 尾形 雄司(OGATA Takeshi). 小川 修(OGAWA Osamu).

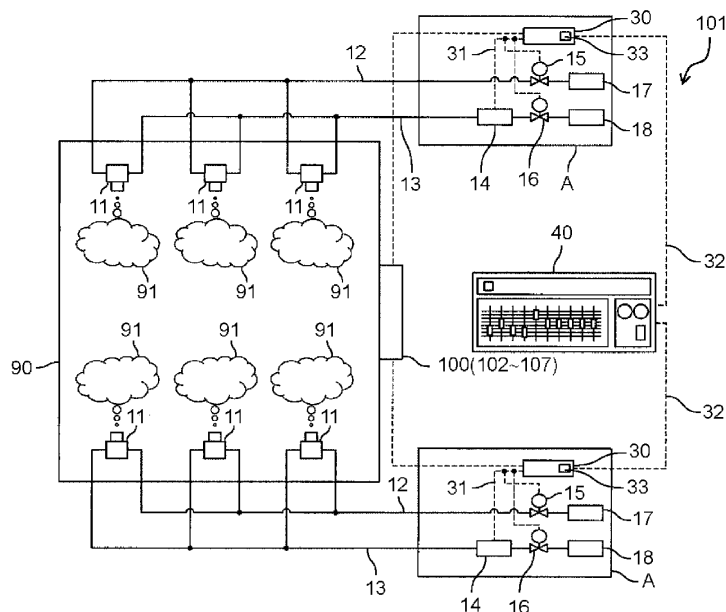
(74) 代理人: 鎌田 健司, 外(KAMATA Kenji et al.);
〒5406207 大阪府大阪市中央区城見2丁目
1番61号 パナソニックIPマネジメ
ント株式会社内 Osaka (JP).

(71) 出願人: パナソニックIPマネジメント株式会
社(PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,

(54) Title: SPRAY DEVICE, SPRAY METHOD, AND MIST SPACE STAGING SYSTEM

(54) 発明の名称: 噴霧装置、噴霧方法、及びミスト空間演出システム



(57) Abstract: This spray device (A) comprises: a two-fluid nozzle (11) that sprays a mist (91); a spray device-side gas channel (12) that supplies a gas to the two-fluid nozzle (11); a gas supply source (17) that supplies the gas to the spray device-side gas channel (12); a spray device-side liquid channel (13) that supplies a liquid to the two-fluid nozzle (11); a fluid supply source (18) that supplies the fluid to the spray device-side liquid channel (13); a pulse-driven liquid flow rate adjustment valve (14) that uses a pulse signal to adjust the valve openness and controls the liquid flow rate of the spray

[続葉有]

DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告 (条約第21条(3))

device-side liquid channel (13); and a control unit (30) that controls the openness of the liquid flow rate adjustment valve (14) to adjust, in a multi-step manner, the mist density of the mist (91) sprayed from the two-fluid nozzle (11).

(57) 要約: 本開示の噴霧装置 (A) は、ミスト (91) を噴霧する二流体ノズル (11) と、二流体ノズル (11) に気体を供給する噴霧装置側気体流路 (12) と、噴霧装置側気体流路 (12) に気体を供給する気体供給源 (17) と、二流体ノズル (11) に液体を供給する噴霧装置側液体流路 (13) と、噴霧装置側液体流路 (13) に液体を供給する液体供給源 (18) と、パルス信号で弁開度を調整して噴霧装置側液体流路 (13) の液体の流量を制御するパルス駆動の液体流量調整弁 (14) と、液体流量調整弁 (14) の弁開度を二流体ノズル (11) から噴霧するミスト (91) のミスト濃度を多段階で調整する制御部 (30) と、を備える。